

NTRCが研究支援に提供する設備一覧及び利用料金明細(2025.7.1改定)

■ NTRC設備の利用料金は下記1-7の合算とする

■ NTRCの装置を利用した場合、データの提供にご協力をお願いできない場合は通常の装置利用料の1.5倍の料金を請求する

1.入室料

入室者1名毎に、共通設備、純水、廃液、ドラフト等の維持整備費として、装置利用料とは別に徴収する。

(予約システムにより、自動的に入室料が加算される。)

実験室	単価(円/日)
クリーンルーム : 202, 205, 207, B106	2000 円/日
その他の実験室 : 化学実験室209, 光学評価室214A, 基板加工室214B, 物性評価室215A,B, 電子顕微鏡室216, 電気計測室B103, バイオ実験室B120など	500 円/日
化学実験室 : 212	1500 円/日

2.装置利用料

(利用料: 単価×利用時間)

設置場所	装置	単価(円/hr)	入室料(円/日)	事由
202	(WS-004)原子層堆積装置(ALD装置)	2,000 円/hr	2,000 円/日	
202	(WS-006)プラズマアッシャー(ヤマト)PR500	500 円/hr	2,000 円/日	
202	(WS-007)ICP-RIE装置	1,000 円/hr	2,000 円/日	
202	(WS-008)CCP-RIE装置	1,000 円/hr	2,000 円/日	
202	(WS-009)Deep-RIE装置	2,500 円/hr	2,000 円/日	
202	(WS-026)高性能分光エリプソメータ(UVISEL ER AGMS iHR320)	1,000 円/hr	2,000 円/日	
202	(WS-030)プラズマCVD装置(TEOS-CVD)	1,500 円/hr	2,000 円/日	
202	XeF2エッチング装置	1,500 円/hr	2,000 円/日	
202	3連電気炉	500 円/hr	2,000 円/日	
202	RTA/RTO	500 円/hr	2,000 円/日	
202	レーザー顕微鏡(門間研寄贈)	500 円/hr	2,000 円/日	
202	レーザー顕微鏡(青)	500 円/hr	2,000 円/日	
202	接触式膜厚測定装置DEKTAK	0 円/hr	2,000 円/日	
202	その他の装置・設備 (202室)	0 円/hr	2,000 円/日	
205	(WS-001)イオンビームスパッタ装置(IFS)	1,500 円/hr	2,000 円/日	Auは貸出(有料)別途請求
205	(WS-002)電子ビーム蒸着装置(ANELVA)EVC-1501	1,000 円/hr	2,000 円/日	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
205	(WS-003)電子ビーム蒸着装置(ULVAC)EBX-6D	1,000 円/hr	2,000 円/日	Au,Ptは貸出(有料)別途請求
205	スパッタ装置(SPC350)	1,000 円/hr	2,000 円/日	
205	スパッタ装置(SPF430H)	1,000 円/hr	2,000 円/日	Auは貸出(有料)別途請求
205	その他の装置・設備 (205室)	0 円/hr	2,000 円/日	
207	(WS-014)紫外線露光装置(両面マスクアライナMA6)	500 円/hr	2,000 円/日	
207	(WS-015)電子ビーム描画装置 ELS-7500	2,000 円/hr	2,000 円/日	
207	(WS-016)レーザー直接描画装置 MLA150	3,000 円/hr	2,000 円/日	
207	その他の装置・設備 (207室)	0 円/hr	2,000 円/日	
209F	(WS-024)誘導結合プラズマ質量分析装置(ICAP_Qc)	2,000 円/hr	500 円/日	
209F	恒温槽(ヤマト化学D N600)	500 円/hr	500 円/日	
209F	その他の装置・設備 (209F室)	0 円/hr	500 円/日	
212	(WS-005)精密めっき装置群+ドラフト群(銅メッキ装置)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	(WS-005)精密めっき装置群+ドラフト群(金メッキ装置)	2,500 円/hr	1,500 円/日	
212	(WS-005)精密めっき装置群+ドラフト群(ニッケルメッキ装置)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	(WS-005)精密めっき装置群+ドラフト群(アルカリドラフト)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	プラズマアッシャー 1 (MCS LF-5)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	プラズマアッシャー 2 (ヤマトPR301)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	分極測定装置 1 (HZ5000)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	分極測定装置 2 (HZ7000)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	CMP研磨システム-1(卓上用)	500 円/hr	1,500 円/日	
212	その他の装置・設備 (212室)	0 円/hr	1,500 円/日	
214(A)	(WS-020)顕微ラマン分光装置	1,000 円/hr	500 円/日	
214(A)	その他の装置・設備 (214A室)	0 円/hr	500 円/日	
214(B)	(WS-027)ダイシングソー(ディスコ)DAD321	500 円/hr	500 円/日	
214(B)	その他の装置・設備 (214B室)	0 円/hr	500 円/日	
215(A)	薄膜物性評価装置	500 円/hr	500 円/日	
215(A)	その他の装置・設備 (215A室)	0 円/hr	500 円/日	
215(B)	(WS-021)触針式段差計tencor(P-15)	500 円/hr	500 円/日	
215(B)	(WS-032)グロー放電分光分析装置(GDOES:JY-5000RF)	1,000 円/hr	500 円/日	
215(B)	A F M装置(ピーコ)	500 円/hr	500 円/日	
215(B)	走査プローブ顕微鏡(AFM)	500 円/hr	500 円/日	
215(B)	その他の装置・設備 (215B室)	0 円/hr	500 円/日	
216	(WS-010)集束イオン/電子ビーム加工観察装置(NB5000)	3,000 円/hr	500 円/日	
216	(WS-011)電界放出型走査電子顕微鏡(S-4800)	1,500 円/hr	500 円/日	
216	(WS-012)電界放出型走査電子顕微鏡(SU8240)	1,800 円/hr	500 円/日	
216	(WS-013)電界放出型電子顕微鏡(S5500)	1,500 円/hr	500 円/日	
216	イオンミリング(IM4000)	500 円/hr	500 円/日	
216	簡易SEM(キーエンス)	750 円/hr	500 円/日	
216	卓上型精密研磨装置	500 円/hr	500 円/日	
216	透過型電子顕微鏡(H-7650)	1,000 円/hr	500 円/日	
216	その他の装置・設備 (216室)	0 円/hr	500 円/日	
218	(WS-025)フーリエ変換赤外分光計(FT/IR-6200)	500 円/hr	500 円/日	
218	その他の装置・設備 (218室)	0 円/hr	500 円/日	
B103	(WS-022)高耐圧デバイス測定装置(B1505A)+高耐圧プローバ(F86)	1,500 円/hr	500 円/日	
B103	(WS-023)高性能半導体パラメータアナライザ(B1500A)+プローバ	1,500 円/hr	500 円/日	
B103	(WS-029)電気計測装置群	500 円/hr	500 円/日	
B103	その他の装置・設備 (B103室)	0 円/hr	500 円/日	
B106	イオンミリング装置	1,500 円/hr	2,000 円/日	
B106	エキシマ照射装置1	0 円/hr	2,000 円/日	
B106	エキシマ照射装置2	0 円/hr	2,000 円/日	
B106	接合装置(ウエハーボンダー SB6e)	0 円/hr	2,000 円/日	
B106	プラズマ装置PL8	0 円/hr	2,000 円/日	
B106	接触角計	500 円/hr	2,000 円/日	
B106	日本分光 分光蛍光光度計 FP-8550	500 円/hr	2,000 円/日	
B106	日本分光 紫外可視近赤外分光光度計 V-750	500 円/hr	2,000 円/日	
B106	MFP-3D-IO-OLY分子間プローブ顕微鏡システム	500 円/hr	2,000 円/日	
B106	その他の装置・設備 (B106室)	0 円/hr	2,000 円/日	
B120	(WS-031)共焦点レーザー走査型顕微鏡(FV3000RS)	1,000 円/hr	500 円/日	
B120	その他の装置・設備 (B120室)	0 円/hr	500 円/日	

1) 上記表に具体的な装置名が載っていないものについては「その他の装置・設備(** 室)」で予約する

- 2) 複数名が同じ部屋で同じ機器を利用する場合には、装置予約者以外は「その他の装置・設備（**室）」で予約する
- 3) 特定の研究室がNTRCに研究室所属の装置を持ち込んで、長期かつ独占的に利用する場合には「1.入室料」に準拠した費用を利用日数分徴収する。
ただし、NTRCセンター長が許可した場合は許可内容に従う。
- 4) 単価0円の装置は、NTRCとしてメンテしない場合がある。

3.材料費・消耗品費

種別	内容	備考
一般消耗品	Si基板、ガラス基板、有機試薬、高圧ガス、貴金属試薬、特殊ガス、レジスト等	プロセスに必要なものとして必要により徴収する
スパッタ材料	貴金属 Au	時価
蒸着材料	貴金属 Au、Pt等	時価

4.技術指導料

- 1) NTRCスタッフが外部から依頼されて実施する実習、デバイス作製、データ測定・解析・評価、情報提供等に関して、下記表の技術指導・代行料を所要時間分徴収する。
- 2) 上記1)に使用される装置利用料を利用時間に応じて合わせて請求する。

種別	資格	単価(円/hr)
技術指導・代行	NTRCスタッフ	6,000 円/hr

5.自主事業に関する取扱い

自主事業の場合の利用料は、大学、公的機関、企業を問わず、その都度決定する。

6.一般管理費

早稲田大学内における事務処理経費として上記「1.入室料 2.装置利用料 3.材料費・消耗品費 4.技術指導料」の合計額の20%を徴収する。

7.消費税

1.入室料 2.装置利用料 3.材料費・消耗品費 4.技術指導料 6.一般管理費の合計額の10%を徴収する。